



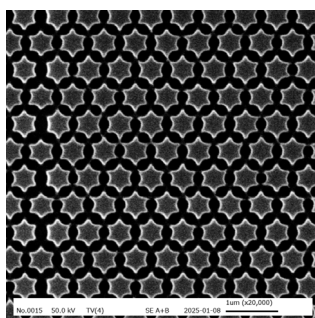
ナノ・マイクロスケールの微細加工入門シリーズ

電子線リソグラフィによるナノパターン描画

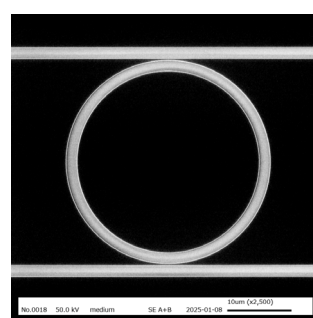
～ナノスケールの加工をお考えの方へ～



電子線描画装置



ナノ周期構造



マイクロリング共振器

日時

2026 年 3 月 10 日(火)

～ 2026 年 3 月 19 日(木)

(上記視聴期間内であれば、何回でも視聴可能です。)

定員

20 名

受講料

2,000 円

申込締切日

2026 年

2 月 27 日

(金)

特徴

- ・リソグラフィ技術を利用した微細加工プロセスについて、実験動画を交えて入門知識を解説します。
- ・電子リソグラフィ技術によるナノスケールの微細パターンを描画する技術をご紹介します。
- ・実際に利用する際に必要なCAD設計のノウハウ、装置描画パラメータの選定方法などを解説します。

詳細は裏面またはこちら



お問合せ先

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 技術振興室 技術セミナー係
〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 TEL:03-5530-2308
メール宛先: kenshu@iri-tokyo.jp



地方独立行政法人

東京都立産業技術研究センター
TOKYO METROPOLITAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

技術セミナー（オンデマンド配信）

電子線リソグラフィによるナノパターン描画～ナノスケールの加工をお考えの方へ～

概 要

ナノスケールの微細な構造体を加工する際、試作開発段階では電子線リソグラフィによるパターンニング技術が広く利用されています。基礎編として、リソグラフィ技術を利用した微細加工の概要、電子線描画装置を用いたナノスケールのパターンニングに関する基礎知識を解説します。応用編として、電子線リソグラフィ技術を実際に活用する際に必要となるノウハウについて、具体的なアプリケーション応用事例の紹介や、電子線描画装置用パターン（CAD データ）の設計手法、所望のナノスケール構造体を得るために最適な装置仕様（スペック）や描画条件を選定するための知識を解説します。

電子線リソグラフィによるナノスケール微細加工をご検討中の方や、電子線リソグラフィ技術について理解を深めたい方のお申込みをお待ちしております。配信期間中は繰り返しの視聴が可能です。

プログラム

配信時間	タ イ ト ル	講 師
25分	『リソグラフィ技術の概要と電子線リソグラフィの原理』 ■リソグラフィによる微細加工プロセスの概要 ■電子線リソグラフィ技術の概要	東京都立産業技術研究センター 電気技術グループ 宮下 惟人 リソグラフィ工程の技術支援に従事
75分	『電子線リソグラフィ実践活用セミナー』 ■ナノスケール構造を利用したデバイスの事例 ■最適な描画データ（CAD）の作成に必要なテクニック ■作りたいパターンに適した装置・描画条件の選び方	Bush Clover株式会社 新関 嵩 氏 ナノ・マイクロデバイスの設計、開発、 微細加工全般の受託開発事業に従事

募集要項

- 利用約款** 下記ウェブページでご確認ください。
<https://www.iri-tokyo.jp/service/terms/>
- 応募資格** 原則として、日本の法人の従業員、個人事業主または創業を予定している個人
- 申込方法** 下記ウェブページの申込フォームから、お申込みください。
<https://www.iri-tokyo.jp/seminar-event/seminar-260310/>
- 受講可否** 受講予定者には、請求書およびコンビニ払込書を郵送いたします。
定員などの関係で受講をお断りする場合、電話また電子メールでご連絡いたします。

参加方法

- 動画を視聴するには、オンデマンド配信サイトへのアカウント登録が必要です。お申込み後、自動返信メールに記載されている URL からご登録ください。過去にアカウント登録済みの方は、改めての登録は不要です。配信期間になりましたら、サイト上に動画が表示されます。
- 視聴環境(パソコンなど)は、受講者をご準備ください。
- ブラウザは、Microsoft® Edge^{※1} または Google chrome^{TM※2} をご使用ください。
^{※1※2} Microsoft® Edge はマイクロソフト社の登録商標で、Google chromeTM はグーグル社の商標です。